

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【公開番号】特開2002-134490(P2002-134490A)

【公開日】平成14年5月10日(2002.5.10)

【出願番号】特願2001-315399(P2001-315399)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/31

C 23 C 16/44

H 01 L 21/3065

【F I】

H 01 L 21/31 C

C 23 C 16/44 J

H 01 L 21/302 N

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月26日(2004.7.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項16

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項16】

前記洗浄ガス供給器及び蒸着ガス供給器は、各々、

ガスを供給するためのガス供給部と、

前記ガス供給部で供給されるガスを前記チャンバ内に供給するためのガス供給ラインと

、
前記ガス供給部と前記ガス供給ラインとの間の連結地点に設けられ前記供給されるガスを制御するための切換バルブとを含むことを特徴とする請求項15に記載の化学気相蒸着装置。